

06.2; 06.3; 07

© 1992

ДЛИННОВОЛНОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В ГЕТЕРОСВЕТОДИОДАХ НА ОСНОВЕ $GaInAsSb/GaAlAsSb$

Н.М. Колчанова, А.А. Попов,
Ю.П. Яковлев

1. Данная работа является продолжением ранее начатых работ по созданию и изучению светодиодных структур $n\text{-}GaSb/n\text{-}GaInAsSb/p\text{-}GaAlAsSb$ на основе узкозонного материала $InGaAsSb$. Изменяя состав четверного соединения $InGaAsSb$, ранее были получены высокоеффективные источники спонтанного и когерентного излучения, перестраиваемые в интервале длин волн 1.8–2.35 мкм [1]. Как показали исследования механизмов рекомбинации в таких структурах [2, 3], излучение возникает в них за счет межзонной излучательной рекомбинации неравновесных носителей в активной области твердого раствора $InGaAsSb$. Кроме того, в работах [2, 3] было высказано предположение, что в таких светодиодах наряду с межзонной присутствует интерфейсная рекомбинация дырок с неравновесными электронами, локализованными на мелких уровнях квантовых состояний, возникающих на $n\text{-}n$ границе гетероперехода 11-рода $n\text{-}GaSb-n\text{-}InGaAsSb$.

В настоящей работе представлены первые результаты наблюдения длинноволнового излучения в области 3.6–3.8 мкм в ранее исследованных структурах на основе узкозонного твердого раствора $n\text{-}InGaAsSb$.

2. Нами были исследованы светодиоды двух типов на основе изопериодного узкозонного слоя $n\text{-}InGaAsSb$ постоянного состава (рис. 1). Гетеросветодиоды первого типа (рис. 1, а) выращивались на подложке $n\text{-}GaSb$ ($n=5 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$) методом жидкофазной эпитаксии и состояли из узкозонного активного слоя $n\text{-}In_{0.22}Ga_{0.78}As_{0.19}Sb_{0.98}$ ($n=4 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$; толщина 1.5 мкм; ширина запрещенной зоны $E_g = 0.6 \text{ эВ}$), заключенного между широкозонными эмиттерными слоями $n\text{-} \text{и} \ p\text{-}Al_{0.32}Ga_{0.68}As_{0.02}Sb_{0.98}$ ($n=7 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$, $p=2 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$, толщина $n\text{-области} - 2.5 \text{ мкм}, p\text{-области} - 4.0 \text{ мкм}$, ширина запрещенной зоны $E_g = 1.37 \text{ эВ}$). В структурах второго типа широкозонный слой $n\text{-}AlGaAsSb$ отсутствовал (рис. 1, б). Слой $n\text{-типа}$ легированся Te , а $p\text{-типа} - Ge$. Величины рассогласования решеток подложки и слоев составляли не более $5-7 \cdot 10^{-4}$.

Из полученных гетероструктур изготавливались мезасветодиоды диаметром 300 мкм со сплошным омическим контактом ($A_K + 5\% Te$)

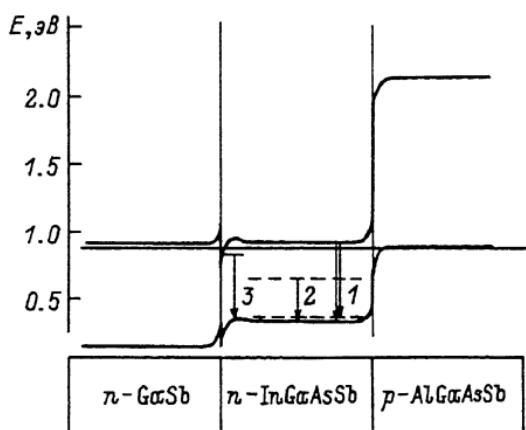
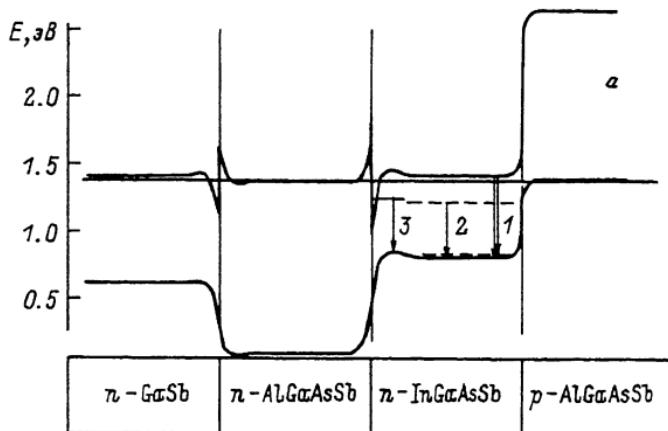


Рис. 1. Энергетические схемы исследованных гетероструктур при $T = 77 \text{ K}$: $n\text{-GaSb}/n\text{AlGaAsSb}/n\text{InGaAsSb}/p\text{AlGaAsSb}$ (а) и $n\text{-GaSb}/n\text{InGaAsSb}/-p\text{AlGaAsSb}$ (б).

к $n\text{-GaSb}$ и точечным ($\text{Au} + 5\% \text{Ge}$, диаметром 40 мкм) kontaktom к $p\text{AlGaAsSb}$.

3. Рассмотрим электролюминесцентные свойства светодиодных структур в длинноволновой области спектра (2.5–4 мкм) при $T = 77 \text{ K}$ (рис. 2).

При малых токах ($1 < 20 \text{ mA}$) спектры излучения состояли из одной полосы (рис. 2, а), энергия максимума которой близка к значению ширины запрещенной зоны узкозонного материала (активной области), E_g которого при $T = 77 \text{ K}$ составляет 0.6 эВ. Это полоса излучения, которую будем называть основной полосой, хорошо изучена; исследована ее зависимость от уровня накачки, температуры и т. д. [2]. Поэтому в дальнейшем мы ее обсуждать не будем. При увеличении тока ($1 > 20 \text{ mA}$) появляется широкая полоса излучения в области длин волн 3.6–3.8 мкм. Величина и форма ее зависят от приложенного напряжения: если в начале это широкая полоса (кривая 1 на рис. 2, б), то по мере роста приложенного напряжения в ней можно выделить две составляющие, ко-

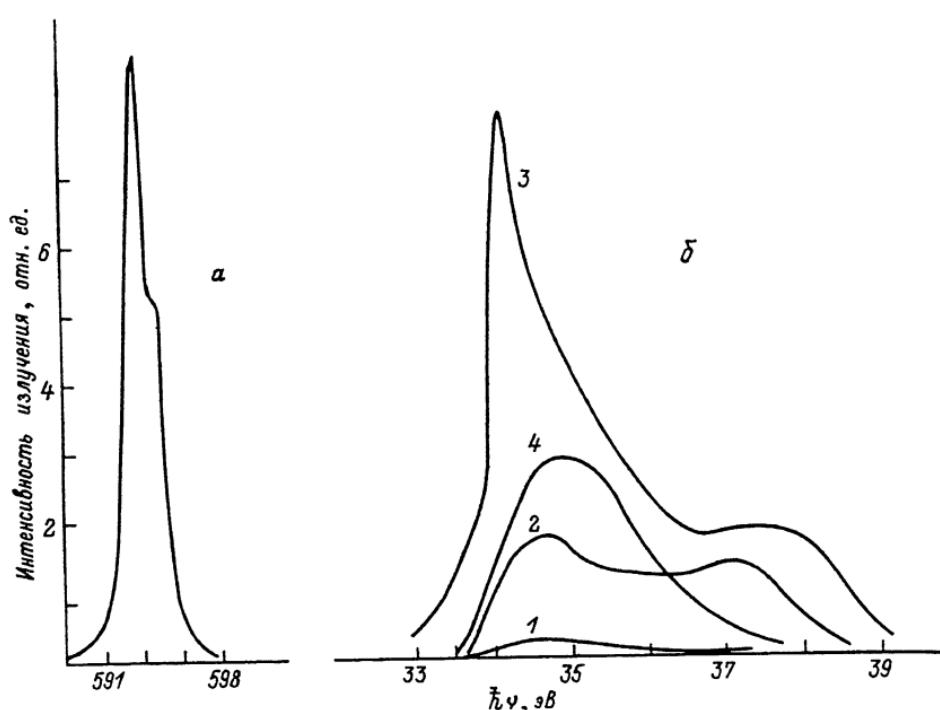


Рис. 2. Спектры электролюминесценции гетероструктуры $n\text{-GaSb}/n\text{AlGaAsSb}/n\text{InGaAsSb}/p\text{AlGaAsSb}$ и $n\text{-GaSb}/n\text{InGaAsSb}/p\text{AlGaAsSb}$ при $T=77$ К. а - основная полоса излучения и б - длинноволновая полоса излучения; структура I-го типа: 1-20 мА, 2-50 мА, 3-1 А; структура II типа - 4-1 А. Масштаб интенсивности на рис. б увеличен в 10^3 по к рис. а.

торые представляют полосы примерно равной интенсивности (кривая 2). При дальнейшем увеличении тока ($1 > 0.5$ А) интенсивность низкоэнергетичной части полосы резко возрастает по отношению к интенсивности ее высокозергетического крыла (кривая 3). Теперь доминирующим становится излучение, энергия максимума которого составляет 0.342 эВ (3.62 мкм); интенсивность его растет, полоса сужается. В таких условиях, когда в длинноволновом излучении сформировалась четкая, относительно узкая полоса, была исследована зависимость положения максимума излучения ($\hbar\omega_{\max}$) и его интенсивности от уровня накачки. Наблюдался линейный рост интенсивности излучения без заметного смещения положения максимума полосы излучения. Отметим, что интенсивность этой полосы в $\sim 10^3$ раз меньше интенсивности основной полосы излучения.

Для выяснения природы длинноволнового излучения мы исследовали гетероструктуру второго типа (рис. 1, б). Излучение в длинноволновой области также имело место (кривая 4, рис. 2, б). Оно представляло широкую полосу, подобную той, которую мы имели при малых напряжениях в структуре первого типа. Однако получить пик длинноволнового излучения, подобный представленному на рис. 2, б

(кривая 3) на структурах второго типа не удалось, ни при каких значениях приложенного напряжения.

4. Проанализируем кратко основные результаты исследования – наличие длинноволнового излучения в структуре $n\text{-GaAsSb}/n\text{-AlGaAsSb}/p\text{-InGaAsSb}/p\text{-AlGaAsSb}$ в области 3.6–3.8 мкм, что соответствует энергии 0.34–0.35 эВ. Значение энергии излучения существенно меньше ширины запрещенной зоны активного слоя и ранее на таких структурах не наблюдалось.

При обсуждении природы длинноволновой полосы излучения полезно рассмотреть энергетические диаграммы исследованных гетероструктур, схематический вид которых в статическом режиме при $T=77$ К приведен на рис. 1. Видно, что энергия, при которой наблюдается длинноволновое излучение существенно меньше энергии ширины запрещенной зоны любого из используемых материалов. Это говорит о том, что излучение не связано с переходами зона–зона или зона–мелкий уровень, а обусловлено рекомбинацией неравновесных носителей через глубокие состояния, существующие в системе. Сложный спектр длинноволнового излучения (две и более перекрывающиеся полосы) свидетельствует о том, что излучательный процесс идет несколькими каналами. Беспорно в нем принимают участие глубокие центры, имеющиеся в запрещенной зоне активной области InGaAsSb (переход 2). Экспериментально в этом материале они ранее не были обнаружены, но они существуют в бинарных соединениях группы A^3B^5 и, по–видимому, должны иметь место в многокомпонентных соединениях на их основе. Через эти глубокие центры идет излучательная рекомбинация, что приводит к появлению широкой длинноволновой полосы, наблюдаемой в обоих типах структур (кривая 1, 2, 4, рис. 2, б). Однако на структуре типа 1 при $1 > 0.5$ А появляется длинноволновое излучение на 3.62 мкм, которое не было обнаружено на структурах типа 2. Структуры 1 и 2 различаются только состояниями на $n\text{-}n$ границе (рис. 1). В первом случае это $n\text{-AlGaAsSb}-n\text{-InGaAsSb}$ граница, во втором – это $n\text{-GaSb}-n\text{-InGaAsSb}$. Анализ рис. 1 показывает, что только в структуре типа 1 возможно появление глубоких состояний в квантовой яме на гетерогранице. Поэтому отсутствие в эксперименте узкого пика длинноволнового излучения на структурах второго типа (кривая 4 на рис. 2, б) свидетельствует о том, что длинноволновой пик излучения 3.62 мкм в спектрах электролюминесценции структур первого типа вызван излучательными переходами связанными с гетерограницей $n\text{-AlGaAsSb}-n\text{-InGaAsSb}$. Если в структурах второго типа за рекомбинацию в длинноволновой области ответственны глубокие состояния в запрещенной зоне активного слоя, то в структурах типа 1 на излучательный спектр, связанный с рекомбинацией неравновесных носителей через глубокие состояния, находящиеся внутри запрещенной зоны полупроводника, накладывается излучение, обусловленное локализацией электронно–дырочных пар в квазидвумерной плазме, возникающей на $n\text{-}n$ гетерогранице второго рода $n\text{-AlGaAsSb}-n\text{-InGaAsSb}$ о возможности существования которой сообщалось в работе [4].

Таким образом, в гетероструктурах на основе $InGaAsSb$ можно получить длинноволновое излучение в области 3.6–3.8 мкм, которое обусловлено несколькими механизмами рекомбинации с участием глубоких центров, расположенных как в объеме активной области, так и на ее границе с широкозонным $n-AlGaAsSb$, образующим с $n-InGaAsSb$ гетеропереход П рода. Механизмы рекомбинации будут обсуждены в следующей работе.

В заключение авторы благодарят Капранчика О.П. за помощь в измерениях.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] А н д а с п а е в а А.А., Б а р а н о в А.Н., Г у с е й-
н о в А.А. и др. // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15. В. 15.
С. 71–75.
- [2] А н д а с п а е в а А.А., Б а р а н о в А.Н., Г у с е й-
н о в А.А. и др. // ФТП. 1990. Т. 24. В. 10. С. 1708–
1714.
- [3] Б а р а н о в А.Н., Г у с е й н о в А.А., Р о г а ч е в А.А.
и др. // Письма в ЖЭТФ. 1988. Т. 48. В. 6. С. 342–344.
- [4] А л т у х о в П.Д., М о н а х о в А.М., Р о г а ч е в А.А.
и др. // ФТТ. 1985. Т. 27. В. 2. С. 576–578.

Физико-технический институт
им. А.Ф. Иоффе РАН,
С.-Петербург

Поступило в Редакцию
7 августа 1992 г.